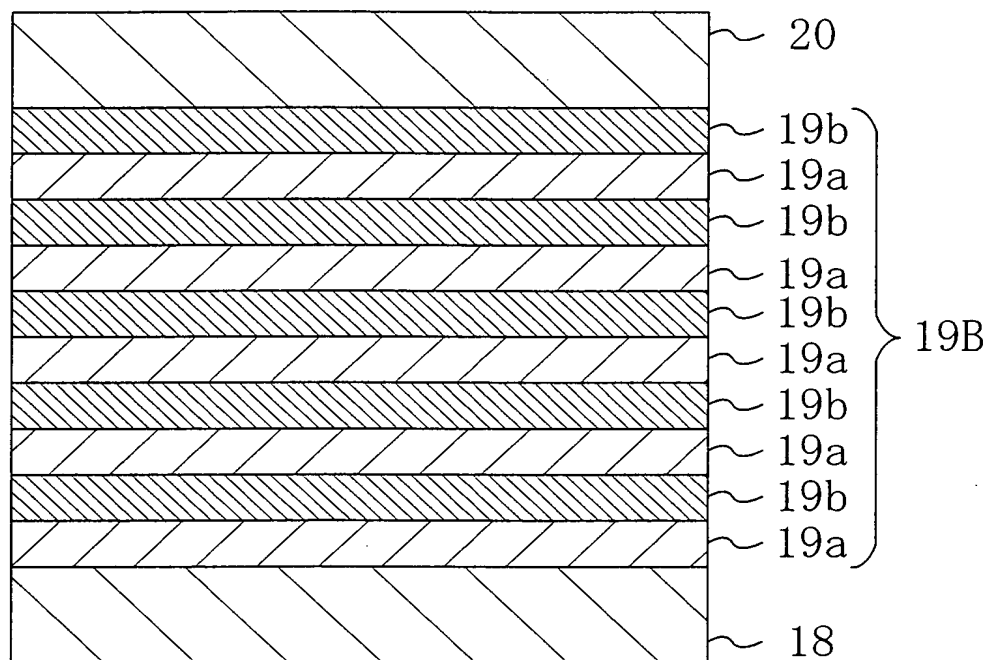


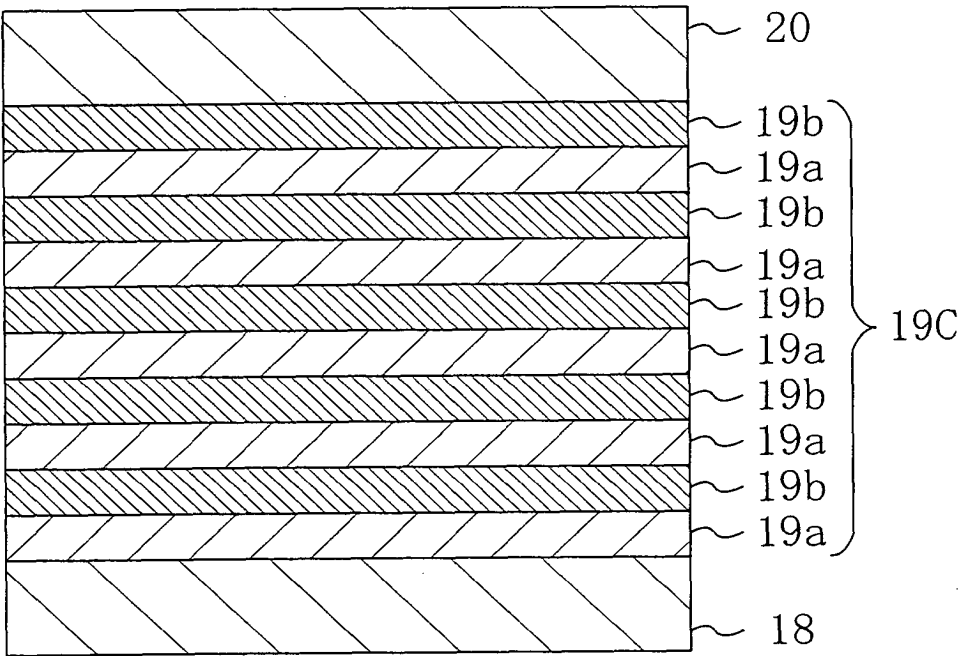
2022.12.24 11:27 095374.1204

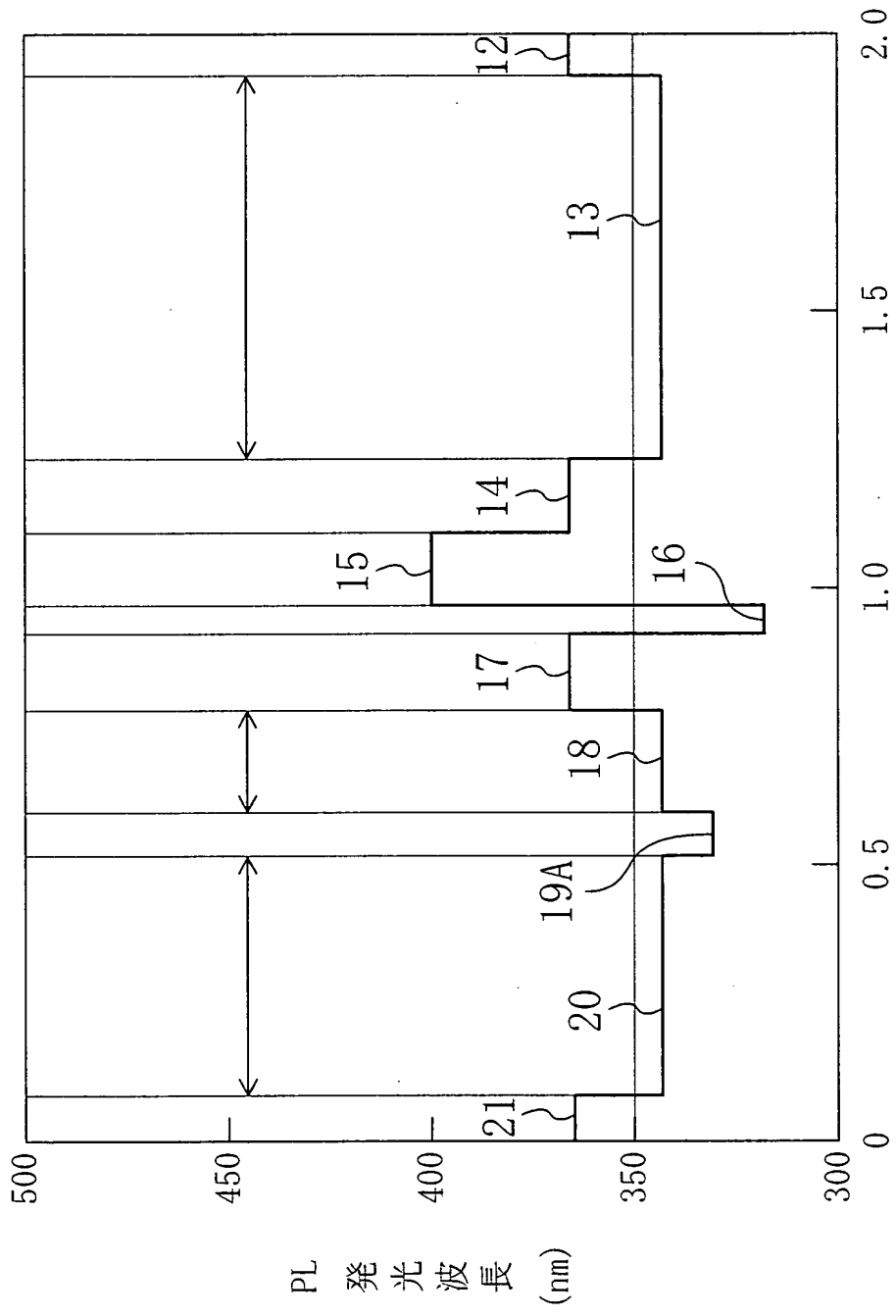






特許第4666号





結晶表面からのエッチング深さ(μm)

